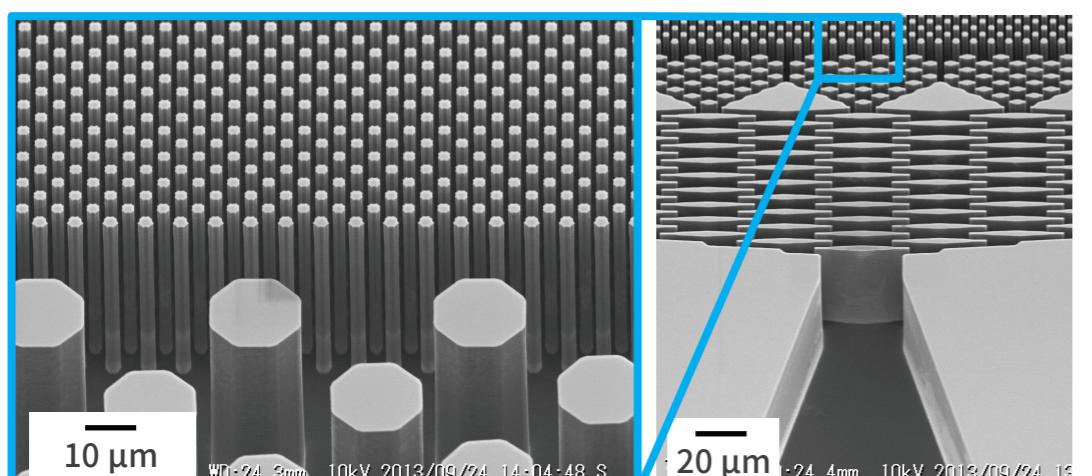


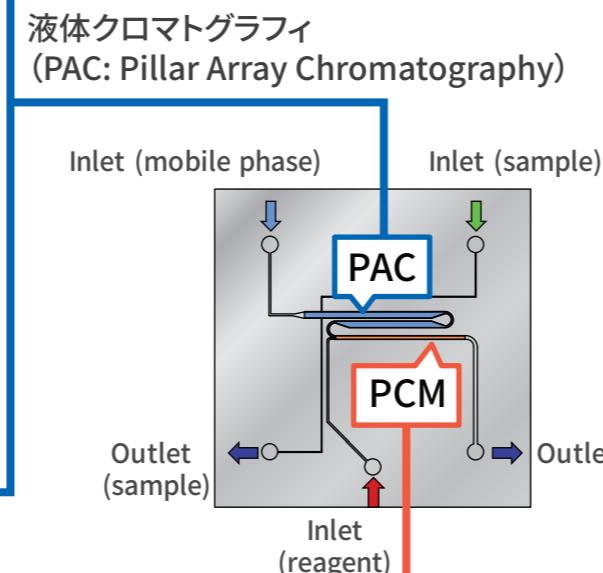
# MEMS

国内外の大学や企業・研究機関との  
協力関係を築き、薄膜技術を用いて  
デバイス進化に貢献

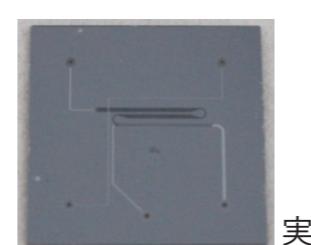
## 液体クロマトグラフィとポストカラムミキサーの作製



高さ30 μmの異なるサイズのピラーを形成しています。

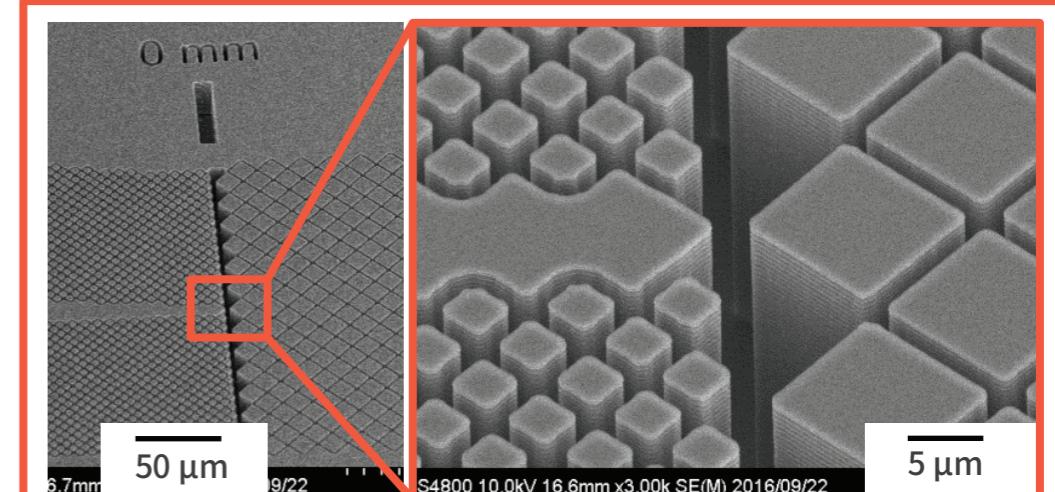


ポストカラムミキサー  
(PCM: Post Column Mixer)

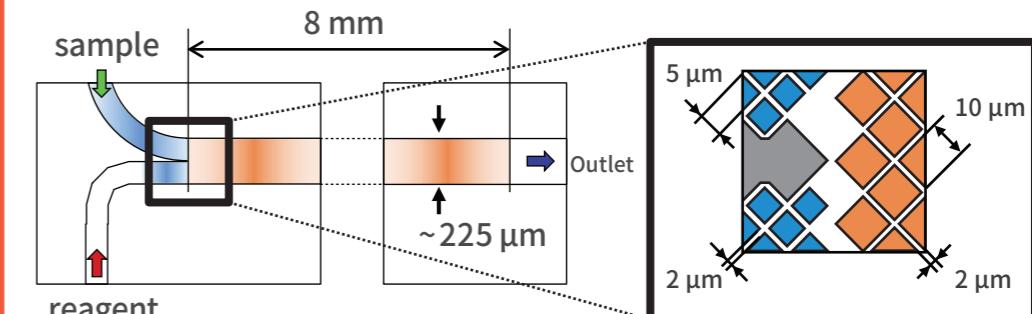


実際のデバイス写真

早稲田大学 電子物理システム学科 庄子研究室 ご提供



高さ20 μmの異なるサイズのピラーを精度よく形成しています。



最大4インチウエハ対応の  
R&D用Si深掘り装置

RIE-400iPB

